

(12) **Patentschrift**

(21) Anmeldenummer:	A 51129/2016	(51) Int. Cl.:	H01L 41/047	(2006.01)
(22) Anmeldetag:	13.12.2016		H01L 41/083	(2006.01)
(45) Veröffentlicht am:	15.09.2018		H01L 41/113	(2006.01)
			G01L 1/16	(2006.01)

(56) Entgegenhaltungen:
WO 2005026678 A1
DE 102011120595 A1
US 2013112010 A1
AT 382968 B

(73) Patentinhaber:
PIEZOCRYST ADVANCED SENSORICS
GMBH
8020 Graz (AT)

(72) Erfinder:
Strmsek Robert Dipl.Ing.
2327 Race (SI)
Baumgartner Martin Dipl.Ing.
8522 Groß St. Florian (AT)
Kröger Dietmar Dr.
8010 Graz (AT)

(74) Vertreter:
Babeluk Michael Dipl.Ing. Mag.
1080 Wien (AT)

(54) **MESSELEMENTSTAPEL ZUM MESSEN VON KRÄFTEN ODER DRÜCKEN UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES DERARTIGEN MESSELEMENTSTAPELS**

(57) Die Erfindung betrifft einen Messelementstapel (10) zum Messen von Kräften oder Drücken aus mehreren piezoelektrischen Kristallelementen (11), die unter Nutzung des transversalen Piezoeffektes mit jeweils entgegengerichteter elektrischer Polarisierung gestapelt sind, die gegenüberliegende erste und zweite Stirnflächen (14, 15) sowie gegenüberliegende dritte und vierte Stirnflächen (24, 25) und parallele Seitenflächen (13) mit Ableitelektroden (12) aufweisen, wobei an den gegenüberliegenden ersten und zweiten Stirnflächen (14, 15) erste und zweite stirnseitige Elektroden (16, 17) angeordnet sind. Erfindungsgemäß sind die gegenüberliegenden dritten und vierten Stirnflächen (24, 25), die auf den Seitenflächen (13) im Wesentlichen normal stehen, als Krafteinleitflächen ausgebildet und wobei jede Ableitelektrode (12) einen elektrisch isolierenden Bereich (20, 30) aufweist.

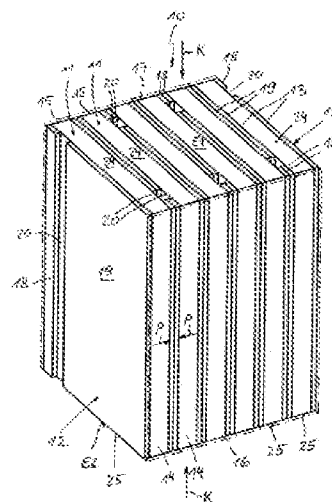


Fig. 1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Messelementstapel zum Messen von Kräften oder Drücken aus mehreren piezoelektrischen Kristallelementen, die unter Nutzung des transversalen Piezoeffektes mit jeweils entgegengerichteter elektrischer Polarisierung gestapelt sind, die gegenüberliegende erste und zweite Stirnflächen sowie gegenüberliegende dritte und vierte Stirnflächen und parallele Seitenflächen mit Ableitelektroden aufweisen, wobei an den gegenüberliegenden ersten und zweiten Stirnflächen erste und zweite stirnseitige Elektroden angeordnet sind. Weiters betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines derartigen Messelementstapels.

[0002] Aus der WO 2005/026678 A1 ist in diesem Zusammenhang ein Messelementstapel bekannt geworden, der aus mehreren, nebeneinander angeordneten, piezoelektrischen Kristallelementen besteht, bei welchen der Transversaleffekt genutzt wird. Die Kristallelemente weisen eine Dicke von ca. 0.5 mm auf und sind als Platten oder flache Quader ausgebildet. Alle sich unter Kraffteinfluss elektrisch aufladenden Seitenflächen sind mit einer seitlichen Elektrode beschichtet. Abgesehen von den beiden äußeren, seitlichen Elektroden des Stapels verbinden die anderen, mittleren Ableitelektroden jeweils zwei benachbarte Kristallelemente fest miteinander. Die Verbindung durch die Ableitelektrode ist derart ausgebildet, dass sie sich unter der maximalen Last, welcher der Messelementstapel ausgesetzt werden soll und im gesamten, für den Stapel zugelassenen Temperaturbereich, nicht löst. Diese Verbindung kann beispielsweise mittels Bonden, Löten oder Thermokompression erreicht werden. Wichtig ist allerdings, dass zwei benachbarte Kristallelemente jeweils mit entgegengesetzten Polarisationsrichtungen angeordnet sind.

[0003] Zur Ladungsabnahme werden die unter Lasteinfluss Kraft aufnehmenden Stirnflächen der Kristallelemente ebenfalls mit einem elektrisch leitenden Material beschichtet. Dadurch entstehen die stirnflächigen Elektroden. Da die seitlichen Ableitelektroden während einer Messung jeweils alternierend entgegengesetzte Ladungen sammeln, ist darauf zu achten, dass benachbarte Ableitelektroden isoliert voneinander ausgeführt sind. Zu diesem Zweck werden die seitlichen Ableitelektroden alternierend von der oberen bzw. von der unteren stirnflächigen Elektrode getrennt.

[0004] Dies geschieht bei der WO 2005/026678 A1 durch das Anbringen einer kerbenartigen Fase am Übergang von der Seitenfläche zur Stirnfläche. Dadurch sammeln sich unter Lasteinfluss jeweils positive Ladungen auf der einen Stirnfläche und negative Ladungen auf der gegenüberliegenden Stirnfläche des Messelementstapels. An diesen, jeweils durch die kerbenartigen Fasen getrennten, stirnflächigen Elektroden kann die Ladungsabnahme von allen seitlichen Ableitelektroden erfolgen.

[0005] Nachteilig bei diesem bekannten Konzept sind insbesondere die kerbartigen Fasen an den kraffteinleitenden Stirnflächen der einzelnen Kristallelemente, die eine Materialschwächung darstellen, die bei hohen Temperaturen und/oder hoher Last bzw. raschem Lastwechsel zu einem Bruch einzelner Kristallelemente in diesem Bereich führen kann.

[0006] Ein weiterer Nachteil besteht darin, dass das Herstellungsverfahren relativ aufwendig ist.

[0007] Aufgabe der Erfindung ist es, einen Messelementstapel zum Messen von Kräften oder Drücken bestehend aus mehreren piezoelektrischen Kristallelementen der eingangs beschriebenen Art derart zu verbessern, dass die oben genannten Nachteile vermieden werden und ein hochtemperaturfester mit hohen Kräften und Drücken belastbarer Messelementstapel realisierbar ist. Eine weitere Aufgabe besteht darin, ein möglichst einfaches Verfahren zur Herstellung eines derartigen Messelementstapels zu beschreiben.

[0008] Erfindungsgemäß wird dies dadurch erreicht, dass die gegenüberliegenden dritten und vierten Stirnflächen, die auf den Seitenflächen im Wesentlichen normal stehen, als planparallele Kraffteinleitflächen ausgebildet sind, wobei jede Ableitelektrode einen elektrisch isolierenden Bereich aufweist.

[0009] Erfindungsgemäß sind somit die Ladungsableitung und die Kraffteinleitung am Messele-

mentstapel völlig entkoppelt und erfolgen über unterschiedliche jeweils gegenüberliegende Außenflächen des Stapels, die für den jeweiligen Zweck optimal und unabhängig voneinander konditioniert werden können.

[0010] Ein erfindungsgemäßes Verfahren zur Herstellung eines Messelementstapels zum Messen von Kräften oder Drücken aus mehreren piezoelektrischen Kristallelementen, die unter Nutzung des transversalen Piezoeffektes mit jeweils entgegengerichteter elektrischer Polarisierung gestapelt werden, ist durch folgende Schritte gekennzeichnet:

- [0011]** a. Bereitstellen von im Wesentlichen quaderförmigen Kristallelementen mit parallelen Seitenflächen, gegenüberliegenden ersten und zweiten Stirnflächen sowie gegenüberliegenden dritten und vierten Stirnflächen mit Rohabmessungen;
- [0012]** b. Aufbringen von Ableitelektroden auf beide Seitenflächen, wobei jeweils elektrisch isolierende Bereiche im Bereich einer der ersten und zweiten Stirnflächen hergestellt werden, und wobei die beiden isolierenden Bereiche unterschiedlichen ersten und zweiten Stirnflächen des Kristallelements zugeordnet sind;
- [0013]** c. Aneinanderreihen mehrerer Kristallelemente zu einem Messelementstapel, so dass die isolierenden Bereiche benachbarter Ableitelektroden aneinander anliegen;
- [0014]** d. Fixierung der Kristallelemente durch eine von außen angreifende Spanneinrichtung;
- [0015]** e. jeweils gemeinsame Bearbeitung der dritten und der vierten Stirnflächen der Kristallelemente in der Spanneinrichtung durch Schleifen und oder Lappen zur Abtragung von Längenunterschieden einzelner Kristallelemente und zur Herstellung von zwei gegenüberliegenden, im Wesentlichen planparallelen Auflageflächen zur Krafteinleitung;
- [0016]** f. Aufbringen einer ersten, stirnseitigen Elektrode auf eine durch die ersten Stirnflächen gebildete, erste Auflagefläche und einer zweiten stirnseitigen Elektrode auf eine durch die zweiten Stirnflächen gebildete, zweite Auflagefläche zur Ladungsableitung; sowie
- [0017]** g. Entfernen der Spanneinrichtung vom Messelementstapel.

[0018] Gemäß einer ersten Ausführungsvariante der Erfindung ist jede Ableitelektrode durch den elektrisch isolierenden Bereich in eine kleinere, an eine der beiden Stirnflächen angrenzende Randlektrode und eine größere Hauptelektrode unterteilt, wobei eine der Hauptelektroden des Kristallelements an dessen erste Stirnfläche angrenzt und die erste stirnseitige Elektrode kontaktiert und die andere Hauptelektrode an dessen zweite Stirnfläche angrenzt und die zweite stirnseitige Elektrode kontaktiert und wobei die Randlelektroden benachbarter Ableitelektroden aneinander anliegen.

[0019] Gemäß einer zweiten Ausführungsvariante der Erfindung ist der elektrisch isolierenden Bereich jeder Ableitelektrode beispielsweise in Form einer randseitigen Fase oder Ausnehmung vorgesehen, wobei ein isolierender Bereich des Kristallelements an dessen erste Stirnfläche und der andere isolierende Bereich an dessen zweite Stirnfläche angrenzt und die isolierenden Bereiche benachbarter Ableitelektroden im Messelementstapel einander zugekehrt angeordnet sind.

[0020] Die Erfindung wird im Folgenden an Hand von Ausführungsbeispielen näher erläutert. Es zeigen:

[0021] Fig. 1 einen erfindungsgemäßen Messelementstapel zum Messen von Kräften oder Drücken bestehend aus mehreren piezoelektrischen Kristallelementen in einer dreidimensionalen Ansicht,

[0022] Fig. 2 den Messelementstapel gemäß Fig. 1 in einer Draufsicht,

[0023] Fig. 3 eine Ausführungsvariante eines erfindungsgemäßen Messelementstapels in einer dreidimensionalen Ansicht,

[0024] Fig. 4 eine weitere Ausführungsvariante eines erfindungsgemäßen Messelementstapels in einer dreidimensionalen Ansicht,

[0025] Fig. 5 eine Variante des Messelementstapels gemäß Fig. 2 in einer Draufsicht, sowie

[0026] Fig. 6 eine Einbausituation des Messelementstapels gemäß Fig. 1 in einen Drucksensor in einer dreidimensionalen Ansicht.

[0027] Funktionsgleiche Teile sind in den Ausführungsvarianten mit gleichen Bezugszeichen versehen.

[0028] Der Messelementstapel 10 gemäß Fig. 1 und 2 besteht aus mehreren, quader- bzw. plattenförmigen, piezoelektrischen Kristallelementen 11, die unter Nutzung des transversalen Piezoeffektes mit jeweils entgegengerichteter, elektrischer Polarisation P gestapelt sind und deren unter Kraffteinfluss elektrische Ladungen generierende Seitenflächen 13 Ableitelektroden 12 aufweisen. An gegenüberliegenden, ersten und zweiten Stirnflächen 14, 15, die auf die Seitenflächen 13 im Wesentlichen normal stehen, sind erste und zweite stirnseitige Elektroden 16, 17 angeordnet (in Fig. 1 strichpunktiert dargestellt), die jeweils gegenüberliegende Seitenflächen des Messelementstapels 10 abdecken.

[0029] Die Kraffteinleitung (siehe Pfeile K) erfolgt beim erfindungsgemäßen Messelementstapel 10 völlig unabhängig vom Ort der Ladungsableitung über die gegenüberliegenden dritten und vierten Stirnflächen 24, 25 der Kristallelemente 11, die auf die Seitenflächen 13 im Wesentlichen normal stehen und als planparallele Kraffteinleitflächen ϵ_1 , ϵ_2 ausgebildet sind. In der Draufsicht gemäß Fig. 2 erfolgt die Kraffteinleitung normal auf die Abbildungsebene.

[0030] Die Schichtdicke der Ableitelektroden 12 und der stirnseitigen Elektroden 16, 17 ist im Vergleich zu den Abmessungen der Kristallelemente 11 überhöht dargestellt, um Details besser sichtbar zu machen.

[0031] Die Ableitelektroden 12 sind durch elektrisch isolierende Bereiche 20 asymmetrisch jeweils in eine kleinere, an eine der beiden Stirnflächen 14, 15 angrenzende Randlektrode 18 und eine größere Hauptelektrode 19 unterteilt, wobei eine der Hauptelektroden 19 des Kristallelements 11 an dessen erste Stirnfläche 14 angrenzt und die erste stirnseitige Elektrode 16 kontaktiert und die andere Hauptelektrode 19 an dessen zweite Stirnfläche 15 angrenzt und die zweite stirnseitige Elektrode 17 kontaktiert.

[0032] Bei der Erfindung wird darauf geachtet, dass die Randlektrode 18 und der elektrisch isolierende Bereich 20 zusammen weniger als 20%, bevorzugt weniger als 5 bis 10%, der Seitenfläche 13 des Kristallelements 11 beanspruchen, um den nicht zum Messsignal beitragenden Randbereich des Kristallelements 11, in welchem sich die Ladungen kompensieren, klein zu halten.

[0033] Die ersten Stirnflächen 14 der gestapelten Kristallelemente 11 und die daran angrenzenden Rand- und Hauptelektroden 18, 19 aller Kristallelemente 11 des Messelementstapels 10 bilden eine geschlossene Auflagefläche für die erste stirnseitige Elektrode 16. Gleiches gilt für die zweiten Stirnflächen 15 und die daran angrenzenden Rand- und Hauptelektroden 18, 19 aller Kristallelemente 11, die eine geschlossene Auflagefläche für die zweite stirnseitige Elektrode 17 bilden.

[0034] Die Kristallelemente 11 weisen somit zwischen den beiden gegenüberliegenden Stirnflächen 24, 25, die der Kraffteinleitung dienen, einen im Wesentlichen einheitlichen Querschnitt auf, der nicht - wie beim Stand der Technik - durch eine stirnseitige Ausbildung von Rundungen und Fasen an den Kanten der Kristallelemente 11 geschwächt ist.

[0035] Bei der Ausführungsvariante gemäß Fig. 1 und 2 können die stirnseitigen Elektroden 16, 17 in einer Dicke von 1 bis 20 μm , vorzugsweise von 2 bis 4 μm , ausgeführt sein und dienen zumindest bei der Montage des Messelementstapels 10, beispielsweise in einem Drucksensor, für den Zusammenhalt der Kristallelemente 11. Eine feste Verbindung der seitlichen Ableitelektroden 12 durch Löten oder Bonden ist daher bei dieser Variante nicht erforderlich.

[0036] Wie in Fig. 2 angedeutet können die isolierenden Bereiche 20 benachbarter Ableitelektroden 12 aufgrund herstellungsbedingter Unterschiede in der Länge oder der Beschichtung einzelner Kristallelemente 11 geringfügig zueinander versetzt angeordnet sein. Es muss lediglich dafür gesorgt sein, dass ein elektrischer Kontakt zwischen der Randlelektrode 18 eines Kristallelements 11 und der Hauptelektrode 19 des benachbarten Kristallelements 11 unterbunden bleibt. Das vereinfacht die Herstellung der mit Ableitelektroden 12 beschichteten Kristallelemente 11, da lediglich die der Kraftereinleitung dienenden Stirnflächen 24, 25 gemeinsam bearbeitet werden müssen, um die planparallelen Kraftereinleitflächen ϵ_1 , ϵ_2 auszubilden. Bei der gemeinsamen Bearbeitung werden die Kristallelemente 11 durch eine von außen - im Wesentlichen normal auf die Seitenflächen 13 der Kristallelemente 11 - angreifende Spanneinrichtung (siehe Pfeile 23 in Fig. 2) zusammengehalten bzw. fixiert.

[0037] Der streifenförmige elektrisch isolierende Bereich 20 kann durch entsprechende Maskierung bei der Aufbringung der Ableitelektrode 12, beispielsweise durch Sputtern, Aufdampfen oder Vacuum Deposition hergestellt werden.

[0038] Es ist auch möglich, den elektrisch isolierenden Bereich 20 durch nachträgliches Ätzen, Fräsen, Schleifen oder durch Laserablation der Ableitelektrode 12 herzustellen, wobei darauf geachtet werden muss, die Seitenflächen 13 des Kristallelements 11 schonend zu behandeln.

[0039] Bei der in Fig. 3 dargestellten Ausführungsvariante weist jede Ableitelektrode 12 einen elektrisch isolierenden Bereich 30, beispielsweise in Form einer randseitigen Fase oder Ausnehmung auf, wobei ein isolierender Bereich 30 des Kristallelements 11 an dessen erste Stirnfläche 14 und der andere isolierende Bereich 30 an dessen zweite Stirnfläche 15 angrenzt und die isolierenden Bereiche 30 benachbarter Ableitelektroden 12 im Messelementstapel 10 einander zugekehrt angeordnet sind.

[0040] Bei der hier dargestellten Ausführungsvariante können die einzelnen Kristallelemente 11 des Stapels 10 mit Hilfe der anderen Seitenflächen 13 angeordneten Ableitelektroden 12 durch Bonden, Löten oder Thermokompression fest miteinander verbunden sein. Die stirnseitigen Elektroden 16 und 17 sind hier in mehrere Teilelektroden unterteilt und werden beim Einbau - wie strichliert mittels seitlicher Elektrode 22 angedeutet - elektrisch leitend verbunden.

[0041] Bei der Ausführungsvariante gemäß Fig. 4 weist jede Ableitelektrode 12 sowie die stirnseitigen Elektroden 16, 17 angrenzend an die für die Kraftereinleitung vorgesehenen dritten und vierten Stirnflächen 24, 25 der Kristallelemente 11 eine elektrisch isolierende Freistellung 35 auf und ist so für den potentialfreien Einbau in einen Drucksensor geeignet.

[0042] Die in Fig. 5 dargestellte Ausführungsvariante der Erfindung unterscheidet sich von jener nach Fig. 1 und 2 dadurch, dass die Randlelektrode 18 und der stirnseitige Randbereich 21 der Hauptelektrode 19 eine größere Materialdicke, beispielsweise die doppelte Materialdicke, als der verbleibende Teil der Hauptelektrode 19 aufweisen (überhöht dargestellt), sodass benachbarten Ableitelektroden 12 im Messelementstapel 10 - bis auf die beiden stirnseitigen Bereiche - voneinander beabstandet sind (siehe Fig. 5). Durch diese Maßnahme kann ein Kontakt benachbarter Ableitelektroden 12 im Messbetrieb selbst bei hoher Temperatur und hohen Kräften bzw. raschen Lastwechseln weitgehend ausgeschlossen werden.

[0043] Die Herstellung eines Messelementstapels gemäß Fig. 5 verläuft im Wesentlichen analog dem bereits beschriebenen Herstellungsverfahren eines Stapels gemäß Fig. 1 und 2, wobei lediglich die stirnseitigen Randlelektroden 18 und ein stirnseitiger Randbereich 21 der Hauptelektroden 19 mit größerer Materialdicke ausgeführt werden, als der verbleibende Teil der Hauptelektroden 19.

[0044] In Fig. 6 ist die Einbausituation eines erfindungsgemäßen Messelementstapels 10 dargestellt, der zwischen dem Druckstempel 40 einer Sensormembran 41 und einem Gegenlager eines nicht weiter dargestellten Drucksensors eingespannt ist. Zur elektrischen Isolierung des Messelementstapels 10 gegenüber den anliegenden, elektrisch leitenden Teilen des Drucksensors sind isolierende Auflagen 42, 43, beispielsweise aus Keramik, vorgesehen. Die Auflage 43 wird von elektrischen Leitern 44, 45 durchsetzt, die die stirnseitigen Elektroden 16 und 17

des Messelementstapels 10 kontaktieren.

[0045] Bei einem Drucksensor mit einer beispielsweise keramischen Sensormembran 41 sowie einem elektrisch isolierenden Gegenlager (z.B. ebenfalls aus Keramik) können die Auflagen 42 und 43 entfallen, sodass ein kompakter Aufbau des Sensors gewährleistet ist.

[0046] Die isolierenden Auflagen 42, 43 können selbst bei einem Drucksensor mit Metallgehäuse und elektrisch leitendem Membranmaterial entfallen, wenn ein Messelementstapel 10 gemäß Fig. 4 eingesetzt wird, der auf beiden Seiten des Stapels elektrisch isolierende Freistellungen 35 aufweist.

[0047] Die Messgenauigkeit des erfindungsgemäßen Messelementstapels 10 wird erhöht, da die der Kräfteinleitung dienenden Flächen ε_1 und ε_2 (siehe Fig. 4, 5) in einem Arbeitsgang gemeinsam hergestellt werden können.

Patentansprüche

1. Messelementstapel (10) zum Messen von Kräften oder Drücken aus mehreren piezoelektrischen Kristallelementen (11), die unter Nutzung des transversalen Piezoeffektes mit jeweils entgegengerichteter elektrischer Polarisierung gestapelt sind, die gegenüberliegende erste und zweite Stirnflächen (14, 15) sowie gegenüberliegende dritte und vierte Stirnflächen (24, 25) und parallele Seitenflächen (13) mit Ableitelektroden (12) aufweisen, wobei an den gegenüberliegenden ersten und zweiten Stirnflächen (14, 15) erste und zweite stirnseitige Elektroden (16, 17) angeordnet sind, **dadurch gekennzeichnet**, dass die gegenüberliegenden dritten und vierten Stirnflächen (24, 25), die auf den Seitenflächen (13) im Wesentlichen normal stehen, als planparallele Kraffteinleitflächen (ϵ_1 , ϵ_2) ausgebildet sind, wobei jede Ableitelektrode (12) einen elektrisch isolierenden Bereich (20, 30) aufweist.
2. Messelementstapel (10) nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass jede Ableitelektrode (12) durch den elektrisch isolierenden Bereich (20) in eine kleinere, an eine der beiden Stirnflächen (14, 15) angrenzende Randlektrode (18) und eine größere Hauptelektrode (19) unterteilt ist, wobei eine der Hauptelektroden (19) des Kristallelements (11) an dessen erste Stirnfläche (14) angrenzt und die erste stirnseitige Elektrode (16) kontaktiert und die andere Hauptelektrode (19) an dessen zweite Stirnfläche (15) angrenzt und die zweite stirnseitige Elektrode (17) kontaktiert und wobei die Randlelektroden (18) benachbarter Ableitelektroden (12) aneinander anliegen.
3. Messelementstapel (10) nach Anspruch 2, **dadurch gekennzeichnet**, dass die ersten Stirnflächen (14) und die daran angrenzenden Rand- und Hauptelektroden (18, 19) aller Kristallelemente (11) des Messelementstapels (10) eine geschlossene Auflagefläche für die erste stirnseitige Elektrode (16) bilden, sowie dass die zweiten Stirnflächen (15) und die daran angrenzenden Rand- und Hauptelektroden (18, 19) aller Kristallelemente (11) eine geschlossene Auflagefläche für die zweite stirnseitige Elektrode (17) bilden.
4. Messelementstapel (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Randlektrode (18) und der stirnseitige Randbereich (21) der Hauptelektrode (19) eine größere Materialdicke, beispielsweise die doppelte Materialdicke, als der verbleibende Teil der Hauptelektrode (19) aufweisen, sodass benachbarte Ableitelektroden (12) im Messelementstapel (10) - bis auf die beiden stirnseitigen Bereiche - voneinander beabstandet sind.
5. Messelementstapel (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet**, dass die stirnseitigen Elektroden (16, 17) in einer Dicke von 1 bis 20 μm , vorzugsweise von 2 bis 4 μm , ausgeführt sind und zumindest bei der Montage des Messelementstapels (10) für den seitlichen Zusammenhalt der Kristallelemente (11) dienen.
6. Messelementstapel (10) nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass der elektrisch isolierenden Bereich (30) jeder Ableitelektrode (12) beispielsweise in Form einer randseitigen Fase oder Ausnehmung vorgesehen ist, wobei ein isolierender Bereich (30) des Kristallelements (11) an dessen erste Stirnfläche (14) und der andere isolierende Bereich (30) an dessen zweite Stirnfläche (15) angrenzt und die isolierenden Bereiche (30) benachbarter Ableitelektroden (12) im Messelementstapel (10) einander zugekehrt angeordnet sind.
7. Messelementstapel (10) nach Anspruch 6, **dadurch gekennzeichnet**, dass die einzelnen Kristallelemente (11) mit Hilfe der Ableitelektroden (12) an deren Seitenflächen (13) durch Bonden, Löten oder Thermokompression fest miteinander verbunden sind.
8. Messelementstapel (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, **dadurch gekennzeichnet**, dass jede Ableitelektrode (12) angrenzend an zumindest eine der für die Kraffteinleitung vorgesehenen dritten und vierten Stirnflächen (24, 25) der Kristallelemente (11) eine elektrisch isolierende Freistellung (35) aufweist.

9. Messelementstapel (10) nach einem der Ansprüche 2 bis 8, **dadurch gekennzeichnet**, dass die isolierenden Bereiche (20, 30) benachbarter Ableitelektroden (12) spiegelgleich oder geringfügig zueinander versetzt angeordnet sind, derart, dass ein elektrischer Kontakt zwischen Elektroden unterschiedlicher Polarität im Überlappungsbereich unterbunden ist.
10. Messelementstapel (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Kristallelemente (11) zwischen den beiden der Kraftereinleitung dienenden, gegenüberliegenden Stirnflächen (24, 25) einen im Wesentlichen einheitlichen Querschnitt aufweisen, ohne stirnseitige Ausbildung von Rundungen und Fasen an den Kanten.
11. Verfahren zur Herstellung eines Messelementstapels (10) zum Messen von Kräften oder Drücken aus mehreren piezoelektrischen Kristallelementen (11), die unter Nutzung des transversalen Piezoeffektes mit jeweils entgegengerichteter elektrischer Polarisierung gestapelt werden, **gekennzeichnet durch** folgende Schritte:
 - a. Bereitstellung von im Wesentlichen quaderförmigen Kristallelementen (11) mit parallelen Seitenflächen (13), gegenüberliegenden ersten und zweiten Stirnflächen (14, 15) sowie gegenüberliegenden dritten und vierten Stirnflächen (24, 25) mit Rohabmessungen;
 - b. Aufbringen von Ableitelektroden (12) auf beide Seitenflächen (13), wobei jeweils elektrisch isolierende Bereiche (20, 30) im Bereich einer der ersten und zweiten Stirnflächen (14, 15) hergestellt werden, wobei die beiden isolierenden Bereiche (20, 30) unterschiedlichen ersten und zweiten Stirnflächen (14, 15) des Kristallelements (11) zugeordnet sind;
 - c. Aneinanderreihen mehrerer Kristallelemente (11) zu einem Messelementstapel (10), so dass die isolierenden Bereiche (20, 30) benachbarter Ableitelektroden (12) aneinander anliegen;
 - d. Fixierung der Kristallelemente (11) durch eine von außen angreifende Spanneinrichtung;
 - e. jeweils gemeinsame Bearbeitung der dritten (24) und der vierten Stirnflächen (25) der Kristallelemente (11) in der Spanneinrichtung durch Schleifen und oder Lappen zur Abtragung von Längenunterschieden einzelner Kristallelemente (11) und zur Herstellung von zwei gegenüberliegenden, im Wesentlichen planparallelen Auflageflächen (ϵ_1 , ϵ_2);
 - f. Aufbringen einer ersten stirnseitigen Elektrode (16) auf eine durch die ersten Stirnflächen (14) gebildete, erste Auflagefläche und einer zweiten stirnseitigen Elektrode (17) auf eine durch die zweiten Stirnflächen (15) gebildete, zweite Auflagefläche, sowie
 - g. Entfernen der Spanneinrichtung vom Messelementstapel (10).
12. Verfahren nach Anspruch 11, **dadurch gekennzeichnet**, dass im Schritt b. die Ableitelektroden (12) jeweils durch den elektrisch isolierenden Bereich (20) in eine kleinere, an eine der beiden Stirnflächen (14, 15) angrenzende Randlektrode (18) und eine größere Hauptelektrode (19) unterteilt werden.
13. Verfahren nach Anspruch 12, **dadurch gekennzeichnet**, dass anschließend an Schritt b. oder im Schritt b. die stirnseitige Randlektrode (18) und ein stirnseitiger Randbereich (21) der Hauptelektrode (19) mit größerer Materialdicke ausgeführt werden, als der verbleibende Teil der Hauptelektrode (19).

Hierzu 3 Blatt Zeichnungen

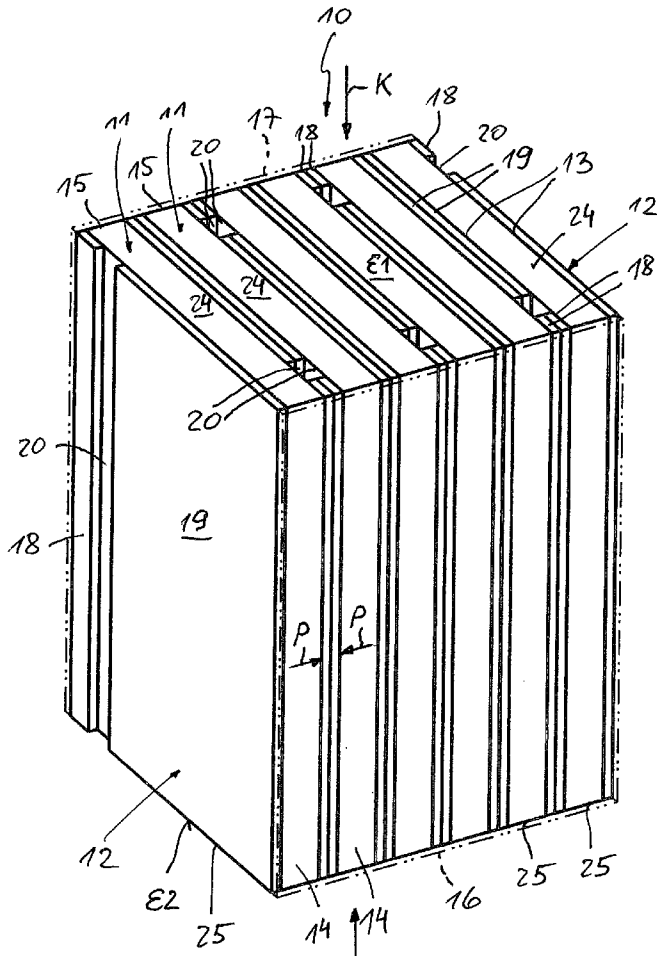


Fig. 1

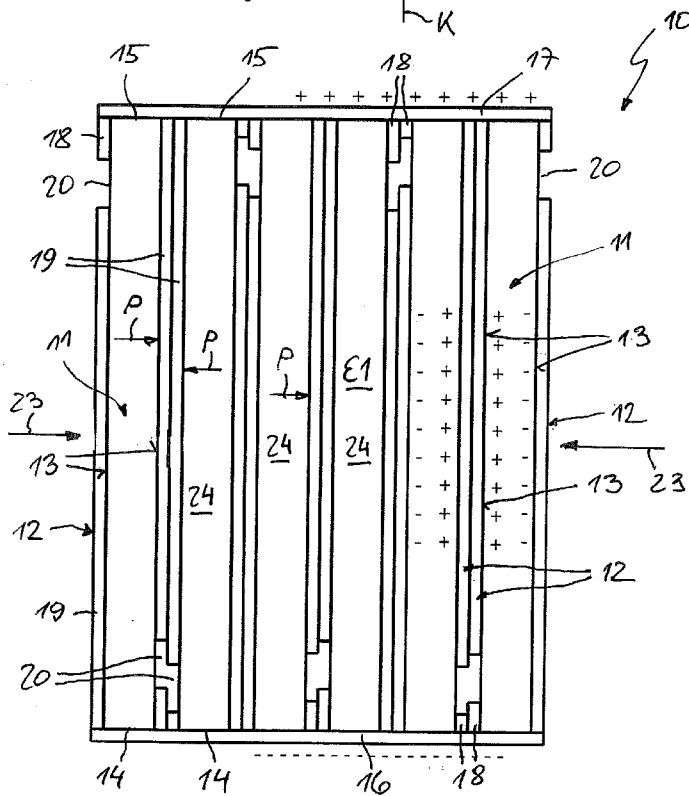


Fig. 2

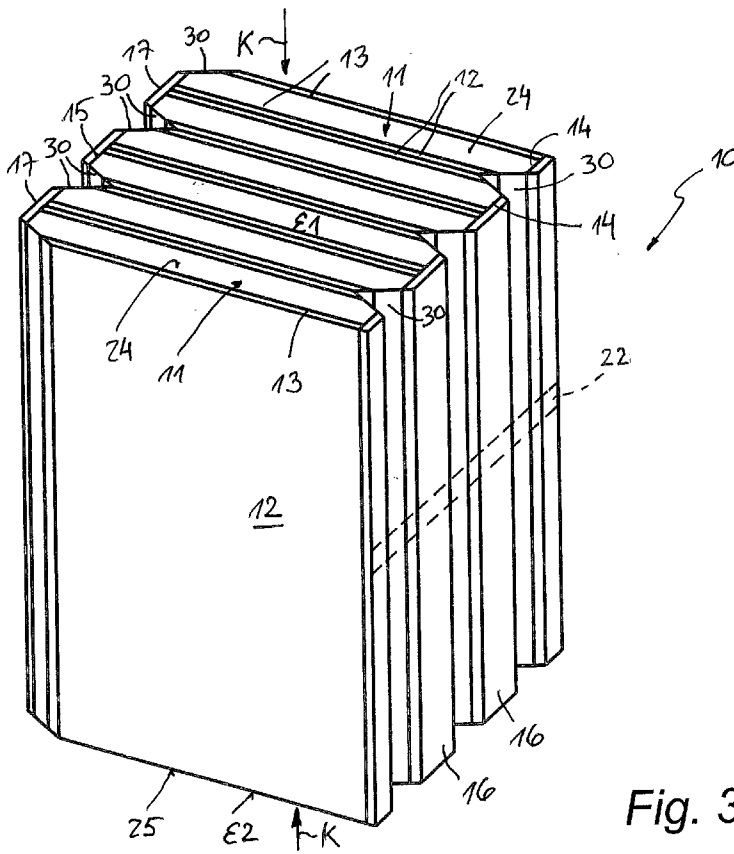


Fig. 3

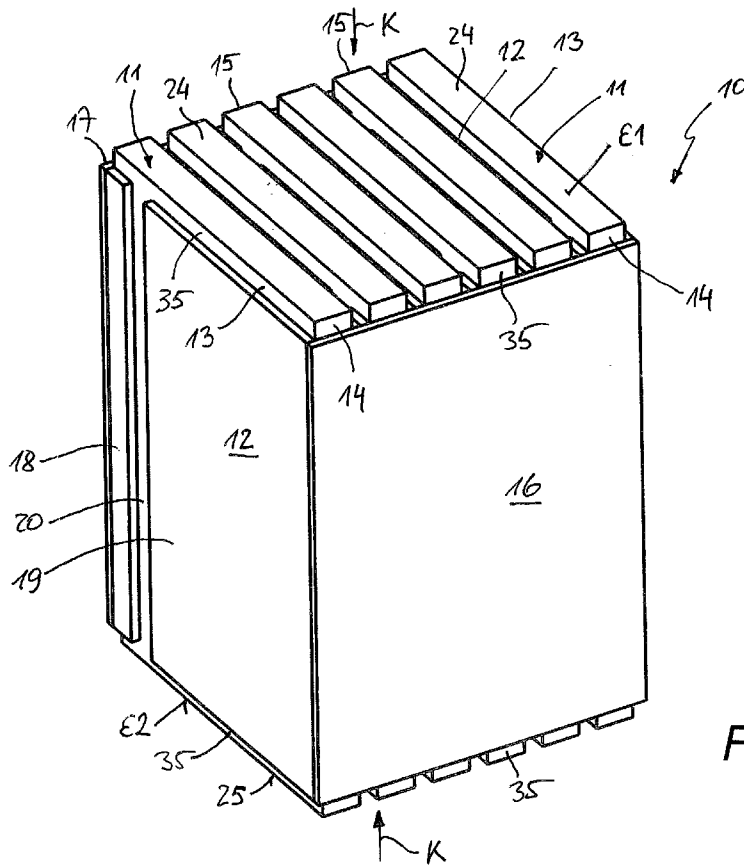


Fig. 4

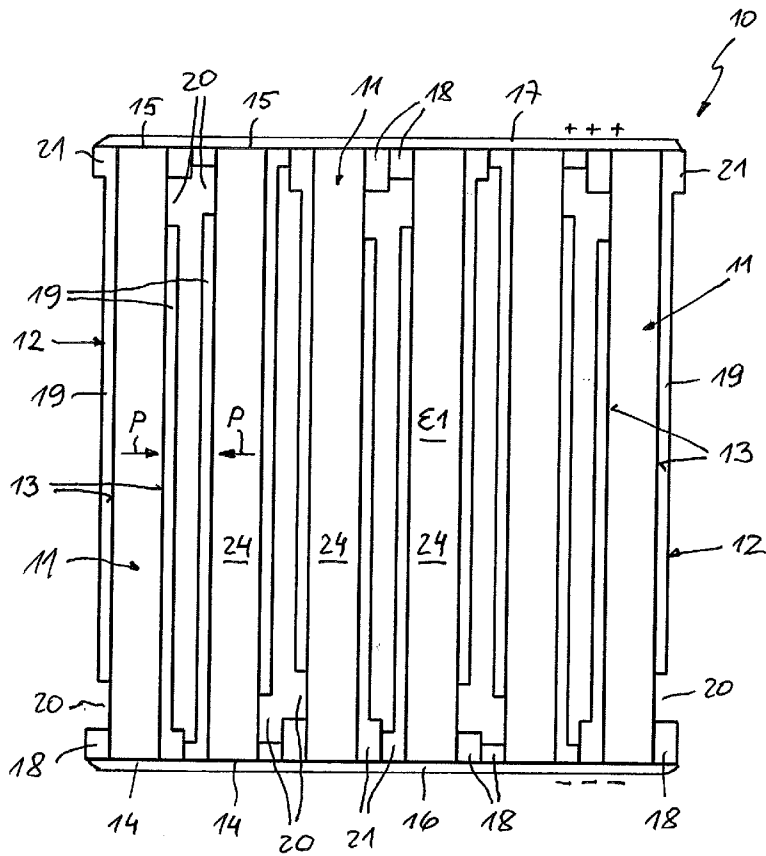


Fig. 5

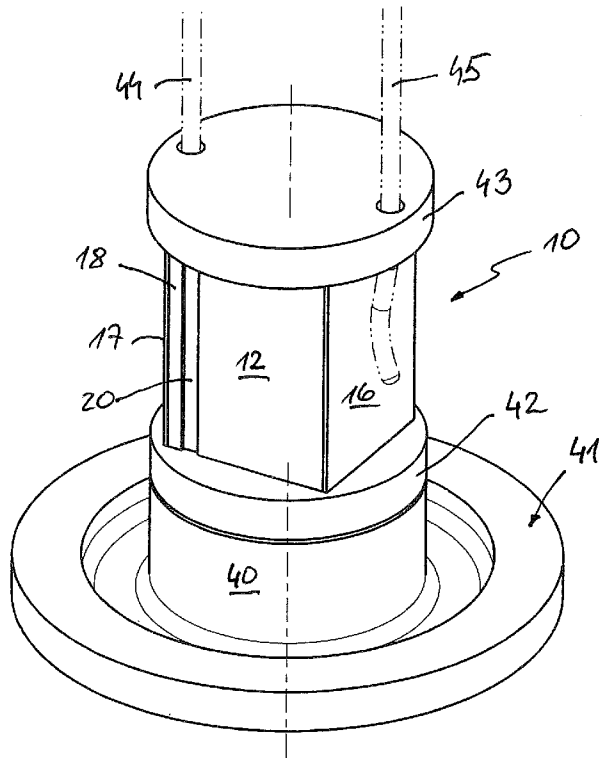


Fig. 6